

고순도 Ptfе 가스 세척병 내부식성 맞춤형 가스 흡수 장치 1/4인치 튜브 연결

품목 번호: PL-CP192



소개

극한의 화학 환경에 맞춰 설계된 이 맞춤형 PTFE 가스 세척병은 보편적인 내부식성과 고순도 가스 흡수를 제공합니다. 1/4인치 튜브에 최적화되어 있어 민감한 산업용 응용 분야에서 누설 방지 성능과 정밀한 습도 조절을 보장합니다.

자세히 알아보기

응용 분야	설명	주요 이점
미량 금속 분석	ICP-MS와 같은 고감도 분석 기기에 들어가기 전에 캐리어 가스에서 불순물을 제거하는 데 사용됩니다.	용출 가능한 오염 물질을 제거하여 배경 노이즈를 방지하고 sub-ppb 검출 한계를 보장합니다.
반도체 가스 처리	웨이퍼 에칭 및 세척 단계에 사용되는 부식성 프로세스 가스(예: HF, HCl)를 스크러빙합니다.	고순도 PTFE는 반도체 장치 수율을 망칠 수 있는 금속 이온 오염을 방지합니다.
환경 시뮬레이션	제어된 기후 조건 하에서 재료의 열화 메커니즘을 테스트하기 위해 특정 습도 환경을 생성합니다.	기계식 분무기에 비해 매우 안정적이고 균일한 습도 기울기를 제공합니다.
석유화학 정제	파일럿 플랜트 반응기의 가스 스트림에서 황화수소(H ₂ S) 또는 기타 산성 성분을 흡수합니다.	거의 보편적인 내부식성은 극도로 공격적인 황화 환경에서 장기 운영을 보장합니다.
제약 합성	특수 반응 경로에서 액체 촉매 또는 흡수 버퍼를 통해 시약 가스의 흐름을 제어합니다.	완전히 불활성인 반응 환경을 제공하여 최종 API(유효 성분)의 순도를 보장합니다.
배터리 연구	배터리 충전/방전 사이클 동안 전해질 테스트 및 가스 발생 분석에 사용됩니다.	부식성 전해질을 견디고 체적 분석을 위해 가스 포집을 정밀하게 제어합니다.
에어로졸 연구	특정 증기압을 달성하기 위해 제어된 버블링을 통해 가스 스트림을 사전 조건화합니다.	정밀 가공은 최적화된 기포 크기와 분포를 허용하여 흡수 효율을 향상시킵니다.
맞춤형 실험실 설정	특수 화학 공학 작업을 위해 맞춤형 진공 라인 또는 압력 조절 매니폴드에 통합됩니다.	맞춤형 포트 크기 및 볼륨은 비표준 실험실 공간에 완벽하게 맞도록 합니다.

특징	PL-CP192에 대한 사양 세부 정보
제품 식별자	PL-CP192 맞춤형 PTFE 가스 세척병
재료 구성	고순도 순수 폴리테트라플루오로에틸렌 (PTFE)
맞춤화 범위	완전히 맞춤화 가능한 치수, 볼륨 및 포트 구성
표준 인터페이스	1/4인치 튜브 커넥터 (요청 시 맞춤 크기 가능)
화학적 내성	모든 일반적인 산, 염기 및 유기 용제에 불활성 (pH 0-14)
작동 온도	-200°C ~ +260°C (넓은 범위에서 일관된 성능)
제조 프로세스	고체 PTFE 블록에서 정밀 CNC 가공
밀봉 메커니즘	통합 밀봉 링이 있는 나사형 PTFE 캡
세척 호환성	오토클레이브 가능; 강력한 세척제 및 초음파 세척기와 호환
표면 마감	잔여물 축적을 최소화하는 부드럽고 낮은 에너지 표면
팁 튜브 설계	맞춤화 가능한 길이 및 팁 스타일 (예: 직절단 또는 프릿형)